

## 权 利 要 求 书

1、一种物理气相沉积腔室，其特征在于，包括腔室本体，在所述腔室  
5 本体内设置有上电极组件，所述上电极组件包括用于承载磁控管的底板组  
件，与所述底板组件间隔设置的背板，以及将所述底板组件与所述背板连接  
的连接组件，

其中，所述连接组件与所述底板组件连接，且所述连接组件与所述背板  
螺纹连接，以能够通过使所述连接组件与所述背板相对移动来调节所述底板  
组件与所述背板之间的间隔大小。

10 2、根据权利要求 1 所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，所述连接  
组件包括连接栓，所述连接栓包括栓头和栓杆，其中，所述栓头与所述底板  
组件连接，所述栓杆与所述背板螺纹连接。

3、根据权利要求 2 所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，所述栓头  
与所述底板组件转动式连接。

15 4、根据权利要求 3 所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，所述栓头  
构造为凸球面；

所述底板组件包括底板主体，在所述底板主体中设置有具有第一凹球面  
的第一凹槽，所述栓头设置在所述第一凹槽中，且所述凸球面与所述第一凹  
球面相适配。

20 5、根据权利要求 4 所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，所述第一  
凹槽的开口端位于所述底板主体的与所述背板相对的第一表面上，所述栓杆  
位于所述底板主体的外侧，并与所述背板螺纹连接；或者，

所述第一凹槽的开口端位于所述底板主体的内部，且在所述底板主体中  
设置有贯通孔，所述贯通孔的一端与所述第一凹槽的开口端连通，另一端位  
25 于所述第一表面上，且所述贯通孔的直径小于所述凸球面的直径，所述栓杆  
从所述贯通孔中伸出，并与所述背板螺纹连接。

6、根据权利要求 5 所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，所述底板

组件还包括固定模块，所述固定模块与所述底板主体可拆卸地连接，且所述固定模块中设置有具有第二凹球面的第二凹槽，所述第二凹球面与所述第一凹球面对接形成一连续的凹球面，所述栓头固定在所述第一凹槽与所述第二凹槽之间，且所述凸球面与所述第一凹球面和第二凹球面相适配。

- 5        7、根据权利要求6所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，在所述底板主体上形成有凹陷，所述固定模块嵌入式安装在所述凹陷内，且所述固定模块的暴露于所述底板主体的表面与所述底板主体的背离所述第一表面的第二表面齐平。

- 10       8、根据权利要求7所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，在所述固定模块上设置有操作孔，所述操作孔的一端与所述第二凹槽连通，另一端位于所述固定模块的暴露于所述底板主体的表面；并且，在所述栓头上对应于所述操作孔设置有操作槽。

- 15       9、根据权利要求1-8任意一项所述的物理气相沉积腔室，其特征在于，所述连接组件的数量为多个，多个所述连接组件间隔布置，且每个所述连接组件均与所述磁控管相互错开。

10、一种物理气相沉积设备，其特征在于，包括根据权利要求1到9中任一项所述的物理气相沉积腔室。